

電子情報通信学会 システムナノ技術に関する時限研究専門委員会主催
第 2 回研究会
「ナノ加工技術とナノ構造評価」

開催主旨：システムナノ技術に関する時限研究専門委員会では、高性能デバイス開発に必要とされる、高精度材料プロセスおよび材料評価技術に関する研究会を開催します。本研究会では、ナノ加工技術およびナノ評価技術の研究開発動向を知ると共に、これらの分野で話題となっている最先端研究・技術開発に関するご講演をいただきます。

日時：2017年6月16日（金）14:00~17:30

会場：機械振興会館 地下3階 B3-6号室

〒105-0011 東京都港区芝公園 3-5-8

TEL: 03-3434-8216（代表）

(<http://www.jspmi.or.jp/kaigishitsu/access.html>)

プログラム：

13:30~ 受付開始

14:00~14:10 開会，委員長挨拶

14:10~14:55 招待講演 「ナノインプリント技術と応用デバイスの研究」
早稲田大学 水野 潤

14:55~15:40 招待講演 「ブロックコポリマーによる自己組織化技術（DSA）」
東京エレクトロン九州（株）プロセス技術部 村松 誠

15:40~15:55 休憩

15:55~16:40 招待講演 「ヘリウムイオン顕微鏡技術による観察・評価と加工」
産業技術総合研究所 ナノエレクトロニクス研究部門 小川 真一

16:40~17:25 招待講演 「STEM を用いた燃料電池材料の 3D 評価」
(株) 日立ハイテクノロジーズ 佐藤 岳志

17:25~17:30 閉会

17:40~ 交流会

申込方法：氏名，連絡先（会社あるいは学校名，所属，郵便番号，所在地，電話番号），交流会参加の有無を E-mail にて SNT 研究会事務局（hida@riken.jp）までお送り下さい。

参加費：一般 3,000 円、学生無料（資料が必要な場合は 1,000 円）、交流会：4,000 円

申込締切：平成 29 年 6 月 7 日（水）

問合先：兵庫県立大学 松井 真二、e-mail: matsui@lasti.u-hyogo.ac.jp

東京理科大学 目黒 多加志、e-mail: meguro@rs.tus.ac.jp

静岡大学 小野 篤史、e-mail: a-ono@rie.shizuoka.ac.jp

(研究会 HP: <http://www.ieice.org/~snt/>)